

2024年4月より

新素材共同研究開発センター  
2024年度共同利用研究に供する装置一覧

装置責任者：新素材共同研究開発センター長 加藤秀実  
電話番号 215-2114 eメールアドレス :hidemi.kato.b7

1. 物質合成ステーション

装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先	
		電話番号	eメールアドレス		電話番号	eメールアドレス
1-1 極微細加工用電子描画・エッチング装置	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	関 剛斎 教授	215-2097	takeshi.seki
1-2 多元系反応スパッタ装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-3 高速反射電子回折装置				関 剛斎 教授	215-2097	takeshi.seki
1-4 複合イオンビーム成膜装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-5 多段制御化学気相析出装置				佐々木 知子 技術職員	215-2375	tomoko.sugiyama.a6
1-6 熱間加工再現試験機	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	山中 謙太 准教授	215-2118	kenta.yamanaka.c5
1-7 放電プラズマ焼結装置 SPS-1050				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7
1-8 放電プラズマ焼結装置 SPS-3.20 Mark IV				原田 晃一 技術職員	215-2375	koichi.harata.e7
1-9 電子ビーム溶解装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
1-10 高圧ガス噴霧装置				佐藤 充孝 助手	215-2233	mitsutaka.sato.a3
1-11 高周波溶解式傾角鋳造装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
1-12 単ロール液体急冷装置				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu

eメールアドレス以下:@tohoku.ac.jp

電話市外局番:022

## 2. 性能評価ステーション

	装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先	
			電話番号	eメールアドレス		電話番号	eメールアドレス
2-1	磁気特性評価システム	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	関 剛斎 教授	215-2097	takeshi.seki
2-2	微小部X線回折装置	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	村上 義弘 技術職員	215-2375	yoshihiro.murakami.e6
2-3	試料水平式エックス線回折装置				村上 義弘 技術職員	215-2375	yoshihiro.murakami.e6
2-4	X線光電子分光分析装置 (XPS)				大村 和世 技術職員	215-2375	kazuyo.omura.b1
2-5	電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-6	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー (FE-EPMA)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-7	走査電子顕微鏡 (W-SEM)				成田 一生 技術職員	215-2375	issei.narita.b4
2-8	超伝導量子干渉計 (SQUID)	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-9	示差走査熱量測定装置 (DSC)	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	和田 武 准教授	215-2112	takeshi.wada.d7
2-10	汎用型熱分析測定システム (DTA,DSC,TMA)				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-11	高輝度X線微小単結晶構造解析装置	杉山 和正 教授	215-2075	kazumasa.sugiyama.e6	杉山 和正 教授	215-2075	kazumasa.sugiyama.e6
2-12	高輝度X線粉末構造解析装置				谷口 貴紀 助教	215-2039	takanori.taniguchi.d3
2-13	温度可変磁化測定装置 (VSM)	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-14	背面反射デジタルCCDラウエカメラ				梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-15	単結晶方位測定装置	杉山 和正 教授	215-2075	kazumasa.sugiyama.e6	川又 透 助教	215-2079	kawamata
2-16	熱電特性評価装置	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-17	レーザーフラッシュ法熱定数測定装置	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	梅津 理恵 教授	215-2199	rie.umetsu
2-18	静的粒子画像分析装置				遠藤 嵩英 技術職員	215-2375	takahide.endo.e5
2-19	平面・断面イオンミリング装置				佐藤 充孝 助手	215-2233	mitsutaka.sato.a3

eメールアドレス以下:@tohoku.ac.jp

電話市外局番:022

## 3. 結晶作製ステーション

	装置名	副装置責任者	副装置責任者連絡先		装置担当者	装置担当者連絡先	
			電話番号	eメールアドレス		電話番号	eメールアドレス
3-1	液相凝固制御装置	加藤 秀実 教授	215-2114	hidemi.kato.b7	戸澤 慎一郎 技術職員	215-2799	shinichiro.tozawa.e4
3-2	抵抗加熱単結晶作製装置				戸澤 慎一郎 技術職員	215-2799	shinichiro.tozawa.e4
3-3	光学式浮遊帯域熔融炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
3-4	電子ビーム式浮遊帯域熔融装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
3-5	高周波加熱単結晶作製装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
3-6	真空高温炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
3-7	高周波溶解炉				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
3-8	超高温浮遊溶解型複合セラミックス作製装置				菅原 孝昌 技術職員	215-2799	takamasa.sugawara.d3
3-9	小型真空アーク溶解装置				野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7
3-10	大型真空アーク溶解装置				野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7
3-11	横型帯域熔融アーク炉				野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7
3-12	高温反応焼結炉				野村 明子 技術職員	215-2799	akiko.nomura.d7

eメールアドレス以下:@tohoku.ac.jp

電話市外局番:022